

# 走査型電子顕微鏡 (SEM) およびエネルギー分散型X線分析装置 (EDS)

キーワード: 画像, 形状, 組成

メーカー: 日本電子(株)

型式: SEM ...JSM-5310LV, EDS ...JED2140

測定項目: SEM ...形状観察, EDS ...組成分析

## 主な仕様及び特長:

形状観察では、試料状態に因り、倍率15~200,000で観察できます(写真右上:花粉2000倍, コーティング有)。最大32mm径の試料が観察できますが、磁気を帯びたもの、水分の多い試料は観察できません。非導体試料は、コーティングなしでも観察可能ですが、コーティングにより鮮明な画像が得られます。また、形状観察中央部分の組成分析(写真中央上)が可能です。

設置場所: 第一研究棟1階

担当者: 電気電子工学科 飯田聡子

連絡先: 0438-30-4112, iida @e.kisarazu.ac.jp

